# МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

Издатель ФГБОУ ВПО "МГТУ им. Н.Э. Баумана". Эл No. ФС77-51038.

УДК 535.317

## Аберрационный синтез лазерных оптических систем

Минахметов А.С., студент Россия, 105005, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра «Радиоэлектроника и лазерная техника»

Научный руководитель: Ширанков А.Ф., к.т.н., начальник отдела НИИ «Радиоэлектроника и лазерная техника» МГТУ им. Н.Э. Баумана Россия, 105005, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана ashirankov@bmstu.ru

#### Введение

При осуществлении аберрационного синтеза оптических систем, предназначенных для преобразования параметров лазерного излучения, необходимо учитывать, что излучение описывается параметрами гауссова пучка, который представляет собой волну, отличную как от сферической, так и от плоской; огибающая гауссова пучка по уровню амплитуды 1/е представляет собой гиперболоид вращения. (Рис. 1) [1].



Рис. 1. Преобразование гауссова пучка линзой

Для выявления аберраций, вносимых линзой в гауссов пучок, стоит рассмотреть экспоненциальный множитель подынтегрального выражения дифракционного интеграла. Поле  $\psi(x, y, z)$  в произвольной точке пространства после тонкой линзы с координатами (х,

y, z) в соответствии со скалярной теорией дифракции определяется путём вычисления дифракционного интеграла 1 [1].

$$\psi(x, y, z) = \frac{iA(z')}{\lambda z} e^{-ikz} \iint exp\{-(ax'^2 + b_x x' + c_x) exp\{-(ay'^2 + b_y y' + b$$

где:

 $\lambda$  — длина волны лазерного излучения, k - волновое число, i — мнимая единица, A(z) — распределение амплитуды поля в точке z на оптической оси

 $\alpha_{\Sigma} = \alpha + \frac{2f'}{8z^3}, \beta_{\Sigma} = \beta + \frac{2f'}{16z^5}, \omega_{\Sigma} = \omega + \frac{5f'}{64z^7}$  – суммарные параметры искажения поля, где z – продольная координата плоскости анализа

f' - фокусное расстояние линзы

$$\alpha = \frac{1}{4} \frac{\frac{1}{r_1^3} - \frac{1}{r_2^3}}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}}; \ \beta = \frac{1}{8} \frac{\frac{1}{r_1^5} - \frac{1}{r_2^5}}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}}; \ \omega = \frac{5}{64} \frac{\frac{1}{r_1^7} - \frac{1}{r_2^7}}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}} - параметры искажения$$

*r*<sub>1</sub>, *r*<sub>2</sub> – радиусы поверхностей линзы

Параметр а определяется как:

$$a = \left\lfloor \frac{1}{h_{\frac{1}{e}}^2} - \frac{a_{\lambda}}{2f'(n_{\lambda} - 1)} \right\rfloor + \frac{ki}{2} \left[ \frac{1}{R'} + \frac{1}{z} - \frac{1}{f'} - \frac{h_{max}^2}{f'} \left( \frac{7}{8} \omega_{\Sigma} h_{max}^4 + \frac{15}{16} \beta_{\Sigma} h_{max}^2 + \alpha_{\Sigma} \right) \right],$$
где

 $h_{\frac{1}{e}}$  – радиус пятна лазерного излучения по уровню 1/е в плоскости, перпендикулярной оси z и касательной к первой поверхности линзы,  $h_{max}$  – максимальный радиус пятна лазерного излучения по уровню 1/е в линзе, R' - радиус кривизны волнового фронта в точке (0,0,z'),  $n_{\lambda}$  - показатель преломления стекла линзы на длине волны  $\lambda$ ,  $a_{\lambda}$  - спектральный коэффициент поглощения излучения стеклом линзы на длине волны  $\lambda$ .

Параметры *b* и *c* определяются как:  $b_x = -\frac{kx}{z}i$ ;  $b_y = -\frac{ky}{z}i$ ;  $c_x = \frac{kx^2}{2z}i$ ;  $c_y = \frac{ky^2}{2z}i$ ;  $T_4(\rho) = \rho^4 - \rho^2 + \frac{1}{8}$ ,  $T_6(\rho) = \rho^6 - 1$ ,  $5\rho^4 + \frac{9}{16}\rho^2 - \frac{1}{32}$ ;  $T_8(\rho) = \rho^8 - 2\rho^6 + 1.25\rho^4 - 0.25\rho^2 + \frac{1}{128}$ ; – полиномы Чебышева, наименее уклоняющиеся от нуля в промежутке[-1;+1], содержащие параметры:  $\rho = \frac{h}{h_{max}}$ ,  $h = \sqrt{z^2 + (x'-x)^2 + (y'-y)^2}$ 

Молодежный научно-технический вестник ФС77-51038, ISSN 2307-0609

Описанный математический аппарат позволяет проанализировать аберрации, вносимые линзой, а так же определить путь синтеза реальных оптических компонентов с наименьшими аберрациями.

#### Определение кривизн поверхностей компонента.

Предлагается рассмотреть преобразование излучения компонентом, состоящим из двух линз, с помощью которых возможно скорректировать аберрации до 7-го порядка. Экспоненциальный множитель подынтегрального выражения дифракционного интеграла возможно представить в виде[2.1]:

$$\varphi = \frac{k}{2f'} \left( \alpha_{\Sigma} + 1,5\beta_{\Sigma}h_{\max}^2 + 1,75\omega_{\Sigma}h_{\max}^4 \right) h_{\max}^4 T_4(\rho),$$

где коэффициенты:

f' – фокусное расстояние компонента (фокусное расстояние компонента f' берется из габаритного расчета);

 $h^2 = x^2 + y^2; h_{\text{max}}$  – максимальный размер пучка на компоненте;  $T_4(\rho = h/h_{\text{max}}) = \rho^4 - \rho^2 + 1/8$  – полином Чебышева, наименее уклоняющийся от нуля в промежутке [-1;+1];

 $\alpha_{\Sigma}, \beta_{\Sigma}, \omega_{\Sigma}$  – параметры, характеризующие аберрации ЛОС 3, 5 и 7-го порядков[2.2]:

$$\alpha_{\Sigma} = \alpha + \frac{f'}{4z^{3}}; \beta_{\Sigma} = \beta - \frac{f'}{8z^{5}}; \omega_{\Sigma} = \omega + \frac{5f'}{64z^{3}};$$
  

$$\alpha = \alpha_{1}\Phi_{1}f' + \alpha_{2}\Phi_{2}f'; \alpha_{1} = \frac{1}{4}\frac{\rho_{1}^{3} - \rho_{2}^{3}}{\rho_{1} - \rho_{2}}; \alpha_{2} = \frac{1}{4}\frac{\rho_{3}^{3} - \rho_{4}^{3}}{\rho_{3} - \rho_{4}};$$
  

$$\beta = \beta_{1}\Phi_{1}f' + \beta_{2}\Phi_{2}f'; \beta_{1} = \frac{1}{8}\frac{\rho_{1}^{5} - \rho_{2}^{5}}{\rho_{1} - \rho_{2}}; \beta_{2} = \frac{1}{8}\frac{\rho_{3}^{5} - \rho_{4}^{5}}{\rho_{3} - \rho_{4}};$$
  

$$\omega = \omega_{1}\Phi_{1}f' + \omega_{2}\Phi_{2}f'; \omega_{1} = \frac{5}{64}\frac{\rho_{1}^{7} - \rho_{2}^{7}}{\rho_{3} - \rho_{4}}; \omega_{2} = \frac{5}{64}\frac{\rho_{3}^{7} - \rho_{4}^{7}}{\rho_{3} - \rho_{4}};$$

 $\Phi_1 = (n_1 - 1)(\rho_1 - \rho_2)$  – оптическая сила первой линзы компонента;  $\Phi_2 = (n_2 - 1)(\rho_3 - \rho_4)$  – оптическая сила второй линзы компонента;  $\rho_j = 1/r_j$  – кривизна преломляющей поверхности компонента  $j = \overline{1,4}$ ;  $r_j$  – радиус кривизны поверхностей компонента;  $n_1, n_2$  – показатели преломления линз компонента.

http://sntbul.bmstu.ru/issue/724133.html

Условие устранения аберраций компонента 3-го порядка эквивалентно  $\alpha_{\Sigma} = 0$ . При этом необходимо обеспечить заданное фокусное расстояние компонента f', что через оптические силы линз компонента представляется как  $f'^{-1} = \Phi_1 + \Phi_2$ .

В случае, когда компонент представляет собой склейку двух линз, параметры  $\rho_2 = \rho_3 = p$  равны между собой в виду сопряженности второй поверхности первой линзы и первой поверхности второй линзы. В данном случае  $\alpha_{\Sigma}$  представляется как:

$$\alpha_{\Sigma} = \frac{1}{4} \frac{\rho_1^3 - p^3}{\rho_1 - p} (n_1 - 1)(\rho_1 - p)f' + \frac{1}{4} \frac{p^3 - \rho_4^3}{p - \rho_4} (n_2 - 1)(p - \rho_4)f' + \frac{f'}{4z^3}$$

Приведённое выше выражение должно обнуляться при исправлении аберраций 3-го порядка, в связи с чем получаем основное уравнение аберрационного синтеза:

$$\frac{1}{4}\frac{\rho_1^3 - p^3}{\rho_1 - p}(n_1 - 1)(\rho_1 - p)f' + \frac{1}{4}\frac{p^3 - \rho_4^3}{p - \rho_4}(n_2 - 1)(p - \rho_4)f' + \frac{f'}{4z^3} = 0$$
(2)

Введя новые переменные  $y = \frac{\rho_1}{p} - 1$ ,  $x = \frac{\rho_4}{p}$ ,  $m = \frac{f'}{z}$ , придем к следующему виду уравнения (2).

$$(y^{3} + 3y^{2} + 3y)(n_{1} - 1) + (1 - x^{3})(n_{2} - 1)f'^{3} + \frac{m^{3}}{p^{3}f'^{3}} = 0$$
(3)

Зная условие обеспечения сохранения фокусного расстояния компонента:  $\frac{1}{f'} = \Phi_1 + \Phi_2$ Возможно записать свободный член уравнения (3)  $\frac{m^3}{p^3 f'^3}$  через переменные х и у как

$$\frac{m^3}{p^3 {f'}^3} = m^3 \big( (n_1 - 1)y + (n_2 - 1)(1 - x) \big)^3$$

Уравнение (3) при данных преобразованиях примет следующий вид:

$$(y^{3} + 3y^{2} + 4y)(n_{1} - 1) + (1 - x^{3})(n_{2} - 1) + m^{3}((n_{1} - 1)y + (n_{2} - 1)(1 - x))^{3} = 0$$

Обозначив  $a = (1 - x^3)(n_2 - 1); n_{11} = n_1 - 1; b = (n_2 - 1)(1 - x)$  возможно получить следующее кубическое уравнение, решаемое относительно переменной у:  $n_{11}(1 + m^3 n_{11}^2) \cdot y^3 + 3n_{11}(1 + n_{11}bm^3) \cdot y^2 + 3n_{11}(1 + m^3b) \cdot y + (a + b^3m^3) = 0$  (4)

Это уравнение имеет, по крайней мере, один действительный корень *у*. Задавая и варьируя неопределённые коэффициент х и m, возможно получить различные решения кубического уравнения для последующей селекции наилучшего. По каждому корню уравнения получаются конструктивные параметры 2-х линзового объектива:

$$\begin{cases} r_2 = f'[(n_1 - 1)y + b] \\ r_1 = r_2/(y + 1) \\ r_4 = r_2/x \\ r_3 = r_4 \end{cases}$$

#### Полные диаметры компонентов

По световому диаметру компонента  $D_C$  из таблицы для соответствующей строки [3] определяются  $\Delta D$ ,  $d_{KR}$  и полный диаметр линз  $D_P$ , которые используются далее для расчета. Причем полный диаметр равен  $D_P = D_C + \Delta D$ . Световые диаметры  $D_C$  компонентов берутся из габаритного расчета компонента.

Таблица 1

<i>D<sub>C</sub></i> , мм	$\Delta D$ , мм	$d_{_{K\!R}}$ , mm ( $f' > 0$ )
< 6	0,6	1,0
≥6<10	1,0	1,2
≥10<18	1,5	1,5
≥18<30	1,8	1,8
≥ 30 < 50	2,0	2,0
≥ 50 < 80	2,5	2,5
≥80<120	3,0	3,0

Полные диаметры компонентов

#### Расчет толщин линз

Расчет толщины линз является следующим важным этапом аберрационного синтеза. Её можно определить, зная радиусы кривизны поверхностей и полный диаметр линзы.

Для начала необходимо определить стрелку прогиба S<sub>i</sub> для каждой из поверхностей:

$$S_i = r_i \left(1 - \sqrt{1 - (
ho_i h)^2}
ight)$$
, где

 $r_i$  — радиус кривизны сферической поверхности

ho — кривизна поверхности

h — высота, на которой определяется стрелка

Для линзы с f'>0 толщина d по оси определяется по формуле:

$$d = d_{\kappa p} + S_1 - S_2$$
, где

 $S_1-$ стрелка прогиба первой поверхности линзы

*S*<sub>2</sub> – стрелка прогиба второй поверхнсоти линзы

 $d_{\rm \kappa p}$  — толщина линзы по краю

Для линзы с f'<0 толщина d по оси определяется по формуле:

$$d = 0.06 \, D_p$$
, где

Случай, когда  $|n_1 - n_2| < 0,00001$ , где  $n_1, n_2$  – показатели преломления входящих в компонент линз:

$$\begin{split} d_{I \text{ линзы}} &= 0,5(d_{\text{кр}} + S_1 - S_2) \\ Ecли \ \rho_1 < \rho_2, \text{ то } d_{II \text{ линзы}} = 0,025D_p \\ Ecлu \ \rho_1 \geq \rho_2, \text{ то } d_{II \text{ линзы}} = d_{I \text{ линзы}} \\ d_{\text{компонента}} &= d_{I \text{ линзы}} + d_{II \text{ линзы}} \\ Cлучай, \text{ когда } |n_1 - n_2| \geq 0,00001 \\ Ecлu \ \rho_1 \geq \rho_2, \text{ mo } d_{I \text{ линзы}} = d_{\text{кр}} + S_1 - S_2 \\ Ecnu \ 8d_{\text{кр}} + d_{I \text{ линзы}} < D_p \text{ , mo } d_{I \text{ линзы}} = 0,125(D_p + 8S_1 - 8S_2); \\ Ecnu \ 2d_{\text{кр}} + 8d_{I \text{ линзы}} < D_p, \text{ mo } d_{I \text{ линзы}} = 0,125(D_p + 8S_1 - 8S_2); \end{split}$$

$$\begin{split} E_{CЛИ} \rho_{3} &\geq \rho_{4}, \ mo \ d_{II \ ЛИНЗЫ} = d_{\mathrm{Kp}} + S_{3} - S_{4} \\ E_{CЛU} \ 8d_{\mathrm{Kp}} + d_{II \ ЛИНЗЫ} &< D_{p} \ , \ mo \ d_{II \ ЛИНЗЫ} = 0,125 (D_{p} + 8S_{3} - 8S_{4}); \\ E_{CЛU} \ \rho_{4} &< \rho_{4}, \ mo \ d_{II \ ЛИНЗЫ} = 0,12D_{p} \ \mathrm{M} \ d_{\mathrm{Kp}} = d_{II \ ЛИНЗЫ} - S_{3} + S_{4} \\ E_{CЛU} \ 3d_{\mathrm{Kp}} + 8d_{II \ ЛИНЗЫ} &< D_{p}, \ mo \ d_{II \ ЛИНЗЫ} = 0,125 (D_{p} + 8S_{3} - 8S_{4}); \\ d_{\mathrm{KOMIOHEHTA}} = d_{I \ ЛИНЗЫ} + d_{II \ ЛИНЗЫ} + d_{\mathrm{Kp}} \end{split}$$

#### Расчёт кардинальных отрезков и точек

Следующим шагом в аберрационном синтезе идет определение кардинальных отрезков и точек.

Фокусное расстояние линзы[4]:

$$f' = \frac{nr_1r_2}{(n-1)[n(r_2 - r_1) + d(n-1)]}$$

Положение фокальных плоскостей[4]:

$$S_F = -f'\left(1 + \frac{n-1}{n}\frac{d}{r_2}\right); \ S'_{F'} = f'\left(1 + \frac{n-1}{n}\frac{d}{r_2}\right)$$

Положение главных плоскостей:[4]

$$S_H = -f' \frac{n-1}{n} \frac{d}{r_2}; \ S'_H = -f' \frac{n-1}{n} \frac{d}{r_2};$$

#### Редуцирование компонента

При переходе от тонкого компонента к толстому «плывут» фокусные расстояния компонента. Для того чтобы, фокусное расстояние компонента оставалось прежним, выполняется процедура редуцирования, при которой радиусы кривизны и толщины компонента умножаются на коэффициент редуцирования.

Фокусное расстояние синтезированного компонента:

 $f_{\text{компонента-аберрационный синтез}} = \frac{f_{I \text{ линзы}}^2 \cdot f_{II \text{ линзы}}^2}{f_{I \text{ линзы}} + f_{2 \text{ линзы}} - d_{\text{кр}}}$ 

Коэффициент редуцирования:

$$A_{peg} = rac{f_{\kappa o m n o h e h t a} - rada p u t h b u h t e s}{f_{\kappa o m n o h e h t a} - a d e p p a u u o h h b u h t e s}$$

Проведя редуцирование компонента, снова высчитывается фокусное расстояние компонента.

### Реализация алгоритма аберрационного синтеза

Анализ аберраций рекомендуется проводить при помощи расчёта хода лучей лучевого пакета для синтезированной части ЛОС – от входной перетяжки всей ЛОС до выходной перетяжки после текущего компонента.

Анализ аберраций в данной работе не рассматривается. Практически любой синтезированный толстый компонент уже считается избавленным от большинства аберраций, но для выбора лучшего варианта аберрационного синтеза, необходимо проводить полный анализ аберраций и выбирать лучший вариант.

При реализации алгоритма аберрационного синтеза необходимо задавать входные параметры, не заданные или являющиеся выходными при габаритном синтезе параметры:

n<sub>1 I</sub> – показатель преломления первой линзы первого компонента

n<sub>2\_I</sub> — показатель преломления второй линзы первого компонента

n<sub>1\_II</sub> – показатель преломления первой линзы второго компонента

n<sub>2 II</sub> — показатель преломления второй линзы второго компонента

 $f_{I}^{\prime}-\varphi$ окусное расстояние первого компонента

 $\mathbf{f}_{\mathrm{II}}^{\prime}-\varphi$ окусное расстояние второго компонента

m – неопределённый коэффициент, просчитывается в интервале [-5,5]

x<sub>4</sub> — неопределённый коэффициент, просчитывается в интервале [—1,1]

h – шаг с которым просчитываются неопределённые коэффициенты





Рис. 2а. Схема алгоритма аберрационного синтеза



Рис. 26. Схема алгоритма аберрационного синтеза

На основе приведенного в данной работе математического аппарата был разработан алгоритм аберрационного синтеза многокомпонентных лазерных оптических систем. Данный алгоритм был применен в разработке программного обеспечения аберрационного синтеза. Разработанная программа дала возможность синтезировать высококачественные лазерные оптические системы, в частности оптическую систему «летучая оптика», применяемой в лазерных гравировщиках.

#### Список литературы

- Пахомов И.И. Расчет преобразования лазерного пучка в оптических системах. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. 53 с.
- Носов П.А., Пахомов И.И., Ширанков А.Ф. Состояние и перспективы развития методов расчета преобразования лазерного излучения оптическими системами // Инженерный журнал: наука и инновации. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2012. №9. Режим доступа: http://engjournal.ru/articles/363/363.pdf (дата обращения 05.09.2014).
- Толстоба Н.Д., Цуканов А.А. Проектирование узлов оптических приборов. Учебное пособие. СПб.: Санкт-Петербургский Государственный Институт Точной Механики и Оптики (Технический Университет), 2002. 129 с.
- Заказнов Н.П., Кирюшин С.И., Кузичев В.И. Теория оптических систем (изд. 3-е). М.: Машиностроение, 1992. 488 с.